HPD™ III

気中パーティクルカウンタ用ディフューザ

不活性ガスの圧力を
大気圧程度にまで減圧する
ディフューザ

Without measurement there is no control

HPD IIIは、大気圧で動作する気中パーティクルカウンタを使用してプロセスガスに含まれる微粒子が測定できるように、パーティクルカウンタに導入する圧縮ガスを大気圧程度にまで減圧するコンパクトなディフューザです。

導入圧力の許容範囲と気中パーティクルカウンタの流量に応じた7つのモデルがあります。

HPD IIIが適応する気中パーティクルカウンタと対応ガス

機種名	CDA	N2	Ar	CO2	O2/He/Ne/H2
Lasair® III 310B,C/350L/5100	Y	Y	Y	N	N
Lasair® Pro	Y	Y	Y	Y	N
NanoAir™ 10	Y	Y	Y	N	N

機能・特長

HPD IIIを接続することで、パーティクルカウンタの用途が広がります。

- クリーンドライエア (CDA) およびアルゴン (Ar)、窒素 (N2)、二酸化炭素 (CO2) などの不活性ガスに対応
- パーティクルカウンタの流量とガスラインの圧力に応じて、2つのモデルから選択
- 流量計の接続が不要
- 強度と耐食性を備えた316Lステンレス鋼製の筐体
- HEPAフィルタを標準装備
- 可動部品のない構造
- 密閉性にすぐれた継手 (VCRオス)

適応機種

以下の気中パーティクルカウンタに接続できます。

- NanoAir™ 10
- Lasair® III 310B、310C、350L、5100
- Lasair® Pro 310、350、5100

PARTICLE MEASURING SYSTEMS®
a spectris company

HPD™ III

気中パーティクルカウンタ用ディフューザ

仕様

導入圧力	下表参照
サンプル流量	下表参照
適応粒径	0.3 – 25 µm
内部清浄度	ISO クラス 5 上限濃度の 5%未満 (出荷時)
材質	筐体：316Lステンレス鋼製、HEPAフィルタ標準装備 ガスケット：316ステンレス鋼製、ニトリルゴムOリング
インレット継手	316Lステンレス鋼製VCR継手オス 1/4 in、ルビーオリフィス付き
アウトレット継手	タケノコ継手、内径 (in)：0.75 / 0.5 / 0.375 / 0.125 (パーティクルカウンタとその流量による)
チューブ長	最大1 m (パーティクルカウンタとの接続に使用するチューブの長さ)
外寸	奥行 380 x 幅 70 x 高さ 140 mm (15 x 2.75 x 5.5 in)
重量	1.25 kg (2.7 lb)
使用環境	温度：4 – 30 °C (39 – 86 °F)　　湿度：結露しないこと

※ ガスラインからHPD IIIにサンプルを導入するためのチューブと継手は別途ご用意ください。

	流量	CDA	N2	Ar	CO2
高圧対応モデル	2.83 LPM	25 – 100 psi	22.5 - 98 psi	29 - 119 psi	31 - 126 psi
	28.3 LPM	25 – 100 psi	24 - 98 psi	30 - 122 psi	32 - 129 psi
	50 LPM	25 – 100 psi	58 - 98 psi	31.5 - 120 psi	32.5 - 128 psi
	100 LPM	60 – 100 psi	58 - 98 psi	71 - 120 psi	75 - 128 psi
低圧対応モデル	28.3 LPM	5 – 25 psi	5 - 24.5 psi	7.5 - 32 psi	8.5 - 34 psi
	50 LPM	5 – 25 psi	5 - 24.5 psi	7.5 - 31.5 psi	8.5 - 33.5 psi
	100 LPM	20 – 60 psi	19.5 - 58.5 psi	24.5 - 72 psi	26.5 - 77 psi

PMS® Japan

PMS日本支社
(スペクトリス株式会社 PMS事業部)
〒210-0024
神奈川県川崎市川崎区日進町7-1
川崎日進町ビル4F
Tel: 044 589 3498 (代表)
Fax: 044 245 5000
Email: pmsjapan@pmeasuring.com

サービスセンター(校正・修理)
Tel: 044 589 3418
Email: svcpmsjapan@pmeasuring.com

https://pmeasuring.jp

PARTICLE MEASURING SYSTEMS®
a spectris company

COMMITTED TO Net Zero

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

Lasair®はParticle Measuring Systems, Inc. の登録商標です。NanoAir™はParticle Measuring Systems, Inc. の商標です。その他記載されている会社名、製品名はそれぞれの会社の商標または登録商標です。記載されている仕様は予告なく変更されることがありますのでご了承ください。 ©2026 Particle Measuring Systems, Inc. 09212026